

QUOTE

日期:2025 年 9 月 12 号

致: 松山湖材料实验室

自: 黎继雄, 武汉颐光科技有限公司

电话:

电话: 13797092046

电子邮件:

电子邮件: jixiong.li@eoptics.com.cn

IRE-200 膜厚仪

技术参数

1、IRE-200 测头参数

- 1) 基本功能: Si、SiC 等材料外延层厚度均可测量
- 2) 光谱波数范围 (cm^{-1}): 5000~500 cm^{-1}
- 3) 光谱波数精度: 0.005 cm^{-1}
- 4) 光谱分辨率: $\leq 0.5 \text{ cm}^{-1}$
- 5) 峰-峰值信噪比: 30000:1
- 6) 光源寿命: >20000 小时
- 7) 外延层厚度范围: 0.3 μm ~200 μm
- 8) 厚度测量精度: $<0.05\mu\text{m}$ ($0.1\mu\text{m} \leq \text{ThicknessEpi} \leq 10\mu\text{m}$)
 $<0.5\%$ ($\text{Thickness Epi} > 10\mu\text{m}$)
- 9) 厚度测量重复性: $<1\%$ or 0.02 μm , 取较大值
- 10) 留边: $<5\text{mm}$
- 11) 单点测量时间: $<5\text{s}$ (标准 Si 外延片)
- 12) 可测晶圆大小: 4-12 寸
- 13) 晶圆厚度: $<10\text{mm}$ (Z 轴行程可调)
- 14) 测量方式: 自动 mapping 测量

2、样品台规格

- 1) 基板尺寸: 最大支持样件尺寸 300*300mm, 兼容 4~12inch 样品
- 2) 载物台移动精度偏差: $<3\mu\text{m}$
- 3) 支持手动放片, 自动 mapping 测量, 测量点数跟位置在 Recipe 中可根据需要编辑
- 4) 可测晶圆大小: 4~12inch 样品
- 5) 晶圆固定方式: 真空吸附



3、软件指标

- 1) 以文字或图形的方式显示当前正在运行的 Recipe 名、测量位置编号、剩余点数等参数。
- 2) 在 Recipe 编辑页可以编辑、调用、存储文件。
- 3) 软件可以根据需求设备测量点数及测量位置。
- 4) 可以生成 2D、3D MAP 图形
- 5) PC 电脑要求: Windows10 操作系统, 预装分析控制软件和微软 office, 硬盘不小于 500G

Model	报价(RMB)
IRE-200 (5000~500cm ⁻¹) 备注: 含 EofilmPro 软件 V2.0	¥ 880,000.00 (捌拾捌万元整)
优惠折扣价	¥ 792,000.00 (柒拾玖万贰仟元整)

备注:

- 以上报价包含电脑、分析软件以及增值税费 (13%), 运输费、安装调试费用;
- 产品 12 个月质保, 2 年内提供不限次免费数据建模分析服务支持;
- 交付货期: 正式签订合同后 60 天内;
- 付款方式: 预付 30%, 发货前 30%, 验收后 30%, 质保期满后付 10%。
- 以上内容仅供参考, 最终解释以合同条款为准。

